

認定プログラムの名称	JCSS (国際 MRA 対応)
認定識別	JCSS 0184 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
法人の名称	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 法人番号 6010605002434
問い合わせ窓口	技術支援部 実証試験技術グループ TEL : 03-5530-2193 FAX : 03-5530-2318



20230821評基第007号
2024年2月4日

認定証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認定識別: JCSS 0184 Calibration

適合性評価機関の名称: 地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

法人の名称: 同上

適合性評価機関の所在地: 東京都江東区青海二丁目4番10号

認定範囲: 長さ、温度、電気(直流・低周波)
(詳細は別紙のとおり)

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (JCSS 認定) に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2024年2月4日

認定の有効期限: 2028年2月3日

初回認定発効日: 2013年8月1日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 斎藤和則

- IA Japan(独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認取決め)に署名している認定機関です。
- 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準(該当する国際規格)適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びにMRA対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項(方針)を指します。
- この事業者はISO/IEC 17025:2017試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです(2017年4月ISO-ILAC-IAF共同コミュニケーション参照)。
- IA Japan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録(認定)に係る区分:長さ

法律に基づく初回登録年月日:2015年6月12日

国際MRA対応初回認定発効日:2015年6月12日

校正手法の区分の呼称【登録更新(認定発効)年月日】:一次元寸法測定器、形状測定器【2024年2月4日】

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ(信頼の水準約95%)
一次元寸法測定器	ノギス	600 mm 以下	0.02 mm
	マイクロメータ	25 mm 以下	0.5 μ m
		25 mm 超 100 mm 以下	2 μ m
	ダイヤルゲージ	5 mm 以下	0.7 μ m
		10 mm 以下	0.5 μ m
		5 mm 超 50.8 mm 以下	1.4 μ m
		50.8 mm 超 100 mm 以下	2.3 μ m
		100 mm 以下	1.6 μ m
	てこ式ダイヤルゲージ	1.6 mm 以下	1.1 μ m
	シリンダゲージ	6 mm 以上 400 mm 以下	1.3 μ m
	デプスゲージ	300 mm 以下	0.02 mm
	ハイトゲージ	1000 mm 以下	0.014 mm
	ダイヤルゲージ校正器	25 mm 以下	0.3 μ m
	伸び計校正器	10 mm 以下	0.15 μ m
		10 mm 超 100 mm 以下	0.40 μ m
	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.11 μ m
		100 mm 超 250 mm 以下	0.20 μ m
	各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による)	310 mm 以下	0.6 μ m
		310 mm 超 610 mm 以下	0.8 μ m
		610 mm 超 1010 mm 以下	1.1 μ m
	リングゲージ	10 mm 以上 200 mm 以下	0.5 μ m
	プラグゲージ	1 mm 以上 200 mm 以下	0.6 μ m
形状測定器	座標測定機用 ゲージ	寸法、距離、 座標又は最小 二乗直径	200 mm 以下 310 mm 以下 310 mm 超 1010 mm 以下
		幾何偏差	10 μ m 以下
	球	平均直径	5 mm 以上 15 mm 以下
			15 mm 超 30 mm 以下

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：温度法律に基づく初回登録年月日：2008年9月10日国際MRA対応初回認定発効日：2013年8月1日校正手法の区分の呼称【登録更新（認定発効）年月日】：接触式温度計【2024年2月4日】恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ(信頼の水準約95%)
接触式温度計	熱電対（比較校正法）	200 °C 以上 1000 °C 以下	1.8 °C

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）法律に基づく初回登録年月日：2006年12月27日国際MRA対応初回認定発効日：2013年8月1日校正手法の区分の呼称【登録更新（認定発効）年月日】：直流・低周波測定器等【2024年2月4日】恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ(信頼の水準約95%)
直流・低周波測定器等	直流抵抗器	1 Ω	1.1 ppm
		10 Ω	1.7 ppm
		100 Ω	1.3 ppm
		1 kΩ	1.8 ppm
		10 kΩ	1.6 ppm
		100 kΩ	2.3 ppm
	直流電圧測定装置	0 mV 以上 110 mV 以下	3.3 μV
		110 mV 超 1000 V 以下	8.5 ppm
	交流電圧測定装置	50 Hz 10 mV 以上 220 mV 以下	0.011 mV
		50 Hz 220 mV 超 1000 V 以下	0.0065 %
	直流電流測定装置	0 μA 以上 110 μA 以下	0.013 μA
		110 μA 超 11 A 以下	0.013 %
		11 A 超 30 A 以下	0.15 %
	交流電流測定装置	50 Hz 0.1 mA 以上 11 A 以下	0.061 %
		50 Hz 11 A 超 50 A 以下	0.15 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。